

Влияние облучения низкоэнергетическими электронами в растровом электронном микроскопе на параметры полупроводниковых приборов

Meiler, Boriss; Kropman, Daniel; Levtsenkova, Alla Микроэлектроника 1987 / с. 165-169 : илл

https://www.ester.ee/record=b2147720*est